

■設備利用料金 (2025.7.1) 赤字:新規登録設備

区分	装置番号	設備	メーカー	型式	学内			学外			管理 部局
					初回講習料 (1回当たり)	利用料金(1時間当たり)		初回講習料 (1回当たり)	利用料金(1時間当たり)		
						装置管理部局内	装置管理部局外		公的機関	一般	
クリーンルーム内設置装置/創成棟内	AP-100028	マスクアライナー	ミカサ	MA-20	12,000	1,700	1,700	13,200	2,900	3,800	電
クリーンルーム内設置装置/創成棟内	AP-100029	真空蒸着装置	サンバック	ED-1500R	20,000	1,900	1,900	22,000	3,000	3,900	電
クリーンルーム内設置装置/創成棟内	AP-100030	反応性イオンエッチング装置	サムコ	RIE-10NRV	12,000	3,400	3,400	13,200	6,700	8,700	電
クリーンルーム内設置装置/創成棟内	AP-100031	ICP高密度プラズマエッチング装置	サムコ	RIE-101iHS	12,000	2,700	2,800	13,200	9,300	12,100	電
クリーンルーム内設置装置/創成棟内	AP-100032	プラズマCVD装置	サムコ	PD-220ESN	20,000	3,300	3,400	22,000	8,200	10,700	電
クリーンルーム内設置装置/創成棟内	AP-100034	液体ソースプラズマCVD装置	サムコ	PD-10C1	20,000	900	900	22,000	1,200	1,500	電
クリーンルーム内設置装置/創成棟内	AP-100035	ヘリコンスパッタリング装置	アルバック	MPS-4000C1/HC1	12,000	5,000	5,100	13,200	7,600	9,900	電
クリーンルーム内設置装置/創成棟内	AP-100037	超高精度電子ビーム描画装置 125kV	エリオニクス	ELS-F125-U	32,000	6,800	7,100	35,200	30,300	39,400	電
クリーンルーム内設置装置/創成棟内	AP-100058	真空紫外光露光装置	エヌ工房	フォトリライター PC-01-H	8,000	200	200	8,800	500	600	電
クリーンルーム内設置装置/創成棟内	AP-100059	分子線エビタキシー装置	Riber	32P	200,000	500	700	220,000	1,300	1,700	工
クリーンルーム内設置装置/創成棟内	AP-100077	超高精度電子ビーム描画装置 100kV	エリオニクス	ELS-7000HM	32,000	4,800	5,100	35,200	27,500	35,700	電
クリーンルーム内設置装置/創成棟内	AP-100083	ドライエッチング装置	アルバック	NLD-500	12,000	1,400	1,400	13,200	2,600	3,300	電
クリーンルーム内設置装置/創成棟内	AP-100084	反応性イオンエッチング装置	サムコ	RIE-101iPH	12,000	3,400	3,400	13,200	7,100	9,300	電
クリーンルーム内設置装置/創成棟内	AP-100085	レーザー描画装置	ネオアーク	DDB-201-200	20,000	700	700	22,000	4,200	5,500	電
クリーンルーム内設置装置/創成棟内	AP-100086	原子層堆積装置	ピコサン	SUNALE-R	12,000	3,500	3,600	13,200	7,500	9,700	電
クリーンルーム内設置装置/創成棟内	AP-100131	コンパクトスパッタ装置	アルバック	ACS-4000-C3-HS	12,000	4,500	4,500	13,200	7,900	10,200	電
クリーンルーム内設置装置/創成棟内	AP-100145	超高速スキャン高精度電子ビーム露光装置	エリオニクス	ELS-F130HM	32,000	8,500	8,600	35,200	41,900	54,400	電
クリーンルーム内設置装置/創成棟内	AP-100146	半導体薄膜堆積装置	パスカル	PAC-LMBE	32,000	2,800	2,800	35,200	8,600	11,200	電
クリーンルーム内設置装置/創成棟内	AP-100254	多元スパッタ装置	アルバック	QAM-4-ST	24,000	7,200	7,200	26,400	10,400	13,500	電
クリーンルーム内設置装置/創成棟内	AP-100255	シリコン深堀りエッチング装置	SPPテクノロジーズ	APX-ASE-Pegasus-Polestar	32,000	5,300	5,300	35,200	14,400	18,700	電
クリーンルーム内設置装置/創成棟内	AP-100256	電子ビーム蒸着装置	エイコーエンジニアリング	EB-580S	24,000	2,900	2,900	26,400	4,500	5,800	電
クリーンルーム内設置装置/創成棟内	AP-100257	レーザー顕微鏡	キーエンス	VK-9700/9710	24,000	800	800	26,400	2,000	2,500	電
クリーンルーム内設置装置/創成棟内	AP-100260	UV-オゾンクリーナー	サムコ	UV-1	8,000	800	800	8,800	900	1,100	電
クリーンルーム内設置装置/創成棟内	AP-100261	光学干渉式膜厚計	フィルメトリクス	F20-UV	24,000	800	800	26,400	1,200	1,600	電
クリーンルーム内設置装置/創成棟内	AP-100262	原子層堆積装置(粉末対応型)	ピコサン	R-200 advanced	24,000	5,600	5,600	26,400	11,700	15,200	電
クリーンルーム内設置装置/創成棟内	AP-100328	レーザー描画装置	ハイデルベルグ・インストルメンツ	DWL66HK	32,000	5,900	6,000	35,200	12,400	16,100	電
クリーンルーム内設置装置/創成棟内	AP-100329	プラズマ式原子層堆積装置	サムコ	AD-230LP-H	32,000	7,000	7,100	35,200	17,400	22,600	電
クリーンルーム内設置装置/創成棟内	AP-100331	卓上型ランプ加熱装置	アドバンス理工	MLA-5000-P-N	32,000	2,300	2,300	35,200	2,600	3,400	電
クリーンルーム内設置装置/創成棟内	AP-100342	微細形状測定機	小坂研究所	ET200	16,000	700	700	17,600	1,200	1,500	電
クリーンルーム内設置装置/創成棟内	AP-100343	マニュアルスパッタ	(自作)	-	16,000	800	800	17,600	1,600	2,100	電
クリーンルーム内設置装置/創成棟内	AP-100384	フッ化セシノドライエッチング装置	サムコ	VPE-4F	8,000	2,300	2,300	8,800	3,900	5,000	電
クリーンルーム内設置装置/理学部棟内	AP-100103	超広帯域波長可変レーザー分光装置	スペクトラ・フィジックス	Tsunami3941-X1S、Opal1.3	8,000	800	1,100	8,800	2,700	3,500	理
クリーンルーム内設置装置/工学部棟内	AP-100299	電子ビーム描画装置	エリオニクス	ELS-3700	24,000	1,100	1,200	26,400	2,600	3,300	情
クリーンルーム内設置装置/工学部棟内	AP-100300	両面マスクアライナ	ズースマイクロテック	MA-6	16,000	800	900	17,600	4,200	5,400	情
クリーンルーム内設置装置/工学部棟内	AP-100301	EB加熱・抵抗加熱蒸着装置	アルバック	EBX-8C	32,000	3,200	3,200	35,200	4,100	5,300	情
クリーンルーム内設置装置/工学部棟内	AP-100302	スパッタ装置	管製作所	SSP3000Plus	24,000	700	700	26,400	2,200	2,900	情
クリーンルーム内設置装置/工学部棟内	AP-100303	ダイシングソー	DISCO	DAD322	16,000	800	800	17,600	1,500	1,900	情
クリーンルーム内設置装置/工学部棟内	AP-100304	エリプソメータ	日本分光	M-500S	5,600	100	100	6,200	1,000	1,200	情
クリーンルーム内設置装置/アイトーブ総合センター	AP-100241	小動物用PET・SPECT・CT装置	シーメンス	Inveon	16,000	4,000	4,000	17,600	14,200	18,500	ア
クリーンルーム内設置装置/アイトーブ総合センター	AP-100347	Ge半導体検出装置	セイコー・イージー & ジー	GMX40P4-76	8,000	1,500	1,500	8,800	3,800	5,000	ア
管理区域内装置(アイトーブ総合センター)	AP-100380	小動物用ベンチトップマイクロCT	ブルカー・ジャパン	MOLECUBES X-CUBE	8,000	1,700	1,700	8,800	6,500	8,500	ア
分光分析装置	AP-100052	結晶分子構造解析装置	日本分光	IRT-3000N	8,000	400	400	8,800	2,500	3,200	電
分光分析装置	AP-100079	顕微ラマンマイクロスコプシステム	レニショー	inVia Reflex	16,000	2,000	2,000	17,600	4,900	6,300	創
分光分析装置	AP-100110	糖鎖解析システム GlycoStation TM	GPバイオサイエンス	GlycoStationReader1200TypeS-1	8,000	400	400	8,800	2,300	2,900	先

■設備利用料金 (2025.7.1) 赤字:新規登録設備

区分	装置番号	設備	メーカー	型式	学内			学外			管理 部局
					初回講習料 (1回当たり)	利用料金(1時間当たり)		初回講習料 (1回当たり)	利用料金(1時間当たり)		
						装置管理部局内	装置管理部局外		公的機関	一般	
分光分析装置	AP-100132	振動円偏光二色性分光光度計	日本分光	JV-2001M	16,000	500	500	17,600	3,000	3,800	先
分光分析装置	AP-100144	高分解能レーザー光散乱分光装置	ジョバンイボン ほか	T64000 ほか	80,000	2,500	2,700	88,000	4,900	6,400	理
分光分析装置	AP-100154	超微量分光光度計	サーモフィッシャーサイエンティフィック	NanoDrop2000	8,000	300	300	8,800	500	600	創
分光分析装置	AP-100215	円偏光二色性分光装置	日本分光	J-820S	8,000	400	400	8,800	1,800	2,400	薬
分光分析装置	AP-100266	マーカス型高周波グロー放電発光表面分析装置	堀場製作所	JY-5000RF Type-HK	32,000	2,300	2,300	35,200	4,000	5,200	工
分光分析装置	AP-100279	フーリエ変換赤外分光光度計	島津製作所	IRAffinity-1S	24,000	5,200	5,200	26,400	6,000	7,800	理
分光分析装置	AP-100291	紫外可視近赤外分光光度計	日本分光	V-770	8,000	100	100	8,800	500	700	地
分光分析装置	AP-100341	顕微紫外可視分光装置	日本分光	MSV-5200	8,000	2,500	2,500	8,800	4,600	6,000	電
分光分析装置	AP-100351	ICP発光分析装置	島津製作所	ICPE-9000	32,000	2,400	2,400	35,200	3,700	4,800	工
分光分析装置	AP-100352	ラマン顕微鏡	堀場製作所	XploRA	16,000	1,700	1,700	17,600	2,700	3,500	工
分光分析装置	AP-100355	ラマンイメージング装置	堀場製作所	HR-Evolution type pa nano	24,000	3,500	3,500	26,400	6,000	7,800	電
分光分析装置	AP-100360	ICP発光分析装置	アジレント・テクノロジー	Agilent 5900 ICP-OES	32,000	3,400	3,400	35,200	5,300	6,900	創
分光分析装置	AP-100370	時間分解分光測定装置	ユニシク	TSP-1000M-01S-H-HP-M	16,000	900	1,000	17,600	2,600	3,300	先
分光分析装置	AP-100378	原子吸光度計	日立ハイテック	ZA4800	16,000	1,000	1,000	17,600	1,900	2,400	農
分光分析装置	AP-100381	紫外可視近赤外分光光度計(積分球付き)	島津製作所	UV-3600i Plus/MPC-603A	24,000	900	900	26,400	1,800	2,300	電
分光分析装置	AP-100382	分光蛍光光度計	日立ハイテック	F-7100	24,000	900	900	26,400	1,900	2,400	電
分光分析装置	AP-100392	顕微フーリエ変換赤外分光光度計	日本分光	FTIR-8X	8,000	500	500	8,800	3,200	4,200	創
電磁波分析装置/X線	AP-100020	X線光電子分光装置	日本電子	JPC-9010MC	32,000	1,900	2,000	35,200	2,900	3,800	触
電磁波分析装置/X線	AP-100045	X線光電子分光装置	日本電子	JPS-9200	28,000	1,600	1,600	30,800	7,900	10,300	電
電磁波分析装置/X線	AP-100054	ナノスケールX線構造解析装置	リガク	Nano-viewer IP	24,000	1,800	1,800	26,400	6,300	8,100	創
電磁波分析装置/X線	AP-100135	極低温X線4軸型回折計	マック・サイエンス	M18X	40,000	2,900	3,000	44,000	8,000	10,400	理
電磁波分析装置/X線	AP-100139	X線回折装置	リガク	Smart Lab	40,000	3,900	3,900	44,000	11,200	14,600	創
電磁波分析装置/X線	AP-100149	粉末X線回折装置	リガク	RINT-Ultima III	8,000	700	700	8,800	2,900	3,700	電
電磁波分析装置/X線	AP-100238	X線光電子分光装置	日本電子	JPS-9200	32,000	1,700	1,800	35,200	7,800	10,100	工
電磁波分析装置	AP-100269	エネルギー分散型蛍光X線分析装置(XRF)	日本電子	JSX-3100R II	32,000	1,600	1,600	35,200	2,500	3,300	工
電磁波分析装置/X線	AP-100272	X線回折装置	リガク	Smart Lab	8,000	2,100	2,100	8,800	2,300	3,000	工
電磁波分析装置/X線	AP-100290	ラウエ結晶方位決定システム	Photonic Science	PSEL_LAUE674.PX5.MG35.SC	8,000	500	500	8,800	2,100	2,700	理
電磁波分析装置/X線	AP-100366	小角・広角X線散乱装置(SAXS/WAXS)	アントンパール	SAXSpoint5.0	24,000	5,200	5,300	26,400	10,400	13,500	先
電磁波分析装置/X線	AP-100394	超深度マルチアングルSEM	キーエンス	VHX-D500	4,000	300	300	4,400	900	1,200	農
電磁波分析装置/X線	AP-100397	デスクトップ3DマイクロX線CT	リガク	CT Lab HX130	128,000	6,000	6,000	140,800	10,300	13,400	農
電磁波分析装置/分光	AP-100041	超薄膜評価装置	日立	HD-2000	16,000	2,700	2,800	17,600	10,400	13,500	電
電磁波分析装置/分光	AP-100147	時間分解光電子顕微鏡システム	エルミテック	PEEM-III	128,000	2,900	3,000	140,800	8,000	10,400	電
電磁波分析装置/分光	AP-100171	代謝光分析システム	浜松ホトニクス	マルチチャンネル分光器PMA12 ほか	16,000	2,000	2,200	17,600	8,600	11,100	電
電磁波分析装置/分光	AP-100200	高性能共焦点レーザー स्क্যান顕微鏡(正立)	ツァイス	LSM700	16,000	900	900	17,600	2,900	3,700	獣
電磁波分析装置/分光	AP-100201	高性能共焦点レーザー स्क্যান顕微鏡(倒立)	ツァイス	LSM700	16,000	900	900	17,600	2,900	3,800	獣
電磁波分析装置/分光	AP-100227	多重極限多核種NMR測定システム(600MHz)	オックスフォード	600/51 Superconducting Magnet System	8,000	1,300	1,400	8,800	23,200	30,200	理
電磁波分析装置/分光	AP-100326	大気中光電子分光装置	理研計器	AC-3	12,000	2,500	2,500	13,200	6,000	7,700	電
電磁気分析装置/質量分析	AP-100091	液体クロマトグラフ飛行時間型質量分析計	ブルカー・ダルトニクス	micrOTOF	8,000	1,400	1,400	8,800	5,700	7,400	地
電磁気分析装置/質量分析	AP-100141	誘導結合プラズマ質量分析装置	アジレント・テクノロジー	8800 ICP-QQQ	40,000	3,200	3,300	44,000	8,100	10,500	創
電磁気分析装置/質量分析	AP-100142	LC/MS/MS装置	エービー・サイエックス	4000-QTRAP	24,000	3,100	3,200	26,400	12,200	15,800	先
電磁気分析装置/質量分析	AP-100150	質量分析装置(MALDI TOF/TOF MS)	ブルカー・ダルトニクス	Ultraflex-III	8,000	2,600	2,600	8,800	4,800	6,200	先
電磁気分析装置/質量分析	AP-100152	高分解能飛行時間型質量イメージングシステム	ブルカー・ダルトニクス	ultrafleXtreme	2,900	2,500	2,600	3,200	8,900	11,500	ア
電磁気分析装置/質量分析	AP-100153	超高分解能質量イメージングシステム	ブルカー・ダルトニクス	solarix XR-ISHI	4,300	8,100	8,300	4,700	24,400	31,700	ア
電磁気分析装置/質量分析	AP-100157	Orbitrap Elite:リニアイオントラップ・電場型FT質量分析装置	サーモフィッシャーサイエンティフィック	Orbitrap Elite	16,000	4,100	4,100	17,600	15,700	20,300	創

■設備利用料金 (2025.7.1) 赤字:新規登録設備

区分	装置番号	設備	メーカー	型式	学内			学外			管理 部局
					初回講習料 (1回当たり)	利用料金(1時間当たり)		初回講習料 (1回当たり)	利用料金(1時間当たり)		
						装置管理部局内	装置管理部局外		公的機関	一般	
電磁気分析装置/質量分析	AP-100158	高分解能飛行時間型質量イメージングシステム	ブルカー・ダルトニクス	ultrafleXtreme-DHS2 TOF/TOF	16,000	3,400	3,500	17,600	13,000	16,800	創
電磁気分析装置/質量分析	AP-100199	安定同位体比質量分析システム	Elementar UK	Iso Prime100 ほか	16,000	1,800	1,900	17,600	7,000	9,100	獣
電磁気分析装置/質量分析	AP-100232	誘導結合プラズマ質量分析装置	アジレント・テクノロジー	ICPMS7700	16,000	2,100	2,100	17,600	4,000	5,200	獣
電磁気分析装置/質量分析	AP-100233	液体クロマトグラフィー質量分析装置	島津製作所	LCMS-8030、LC-2010AHT	16,000	1,000	1,000	17,600	2,700	3,500	獣
電磁気分析装置/質量分析	AP-100234	ガスクロマトグラフィー質量分析装置	サーモフィッシャーサイエンティフィック	FOCUS DSQ II	16,000	300	300	17,600	1,200	1,500	獣
電磁気分析装置/質量分析	AP-100281	化合物データ解析システム Biotage(ADVION CMS)	Advion	expression CMS	8,000	1,700	1,700	8,800	3,600	4,600	先
電磁気分析装置/質量分析	AP-100321	小型自動質量分析装置(HPLC-シングル四重極MS)	ウォータース	Alliance HPLC e2695、ACQUITY QDa検出器	8,000	200	200	8,800	1,500	1,900	薬
電磁気分析装置/質量分析	AP-100357	高速液体クロマトグラフ三連四重極質量分析計	島津製作所	LCMS-8060NX	16,000	3,600	3,600	17,600	7,800	10,100	創
電磁気分析装置/質量分析	AP-100358	ガスクロマトグラフ四重極質量分析計	日本電子	JMS-Q1000GC	16,000	2,000	2,000	17,600	2,400	3,100	創
電磁気分析装置/質量分析	AP-100359	ガスクロマトグラフ三連四重極質量分析計	日本電子	JMS-TQ4000GC	16,000	1,900	2,000	17,600	3,900	5,000	創
電磁気分析装置/質量分析	AP-100373	マルチコレクター型質量分析装置(MC-ICP-MS)	サーモフィッシャーサイエンティフィック	NEPTUNE plus	24,000	3,300	3,300	26,400	17,000	22,000	理
電磁気分析装置/質量分析	AP-100376	質量分析装置(UPLC-MS/MS)	ウォータース	ACQUITYUPLC H-Class PLUS/Xevo TO-S micro	24,000	700	800	26,400	4,000	5,200	農
電磁気分析装置/質量分析	AP-100386	四重極飛行時間型質量分析計システム	ウォータース	Xevo G3 QTof	16,000	800	800	17,600	5,400	7,000	薬
電磁気分析装置/質量分析	AP-100387	トリプル質量分析装置(Orbitrap Eclipse)	サーモ・サイエンティフィック	Orbitrap Eclipse	24,000	4,400	4,500	26,400	30,500	39,600	創
電磁気分析装置/質量分析	AP-100395	多機能オートサンプラー付GC-MS	アジレント・テクノロジー	5977C	32,000	800	800	35,200	4,300	5,600	農
電磁気分析装置/質量分析	AP-100400	同位体比質量分析計	Sercon	INTEGRA2-CN	48,000	4,100	4,100	52,800	9,700	12,700	農
電磁気分析装置/質量分析	AP-100404	HPLC/トリプル四重極型GC-MS	島津製作所	Nexera/TQ8050NX	32,000	1,000	1,000	35,200	4,300	5,600	農
電磁気分析装置/核磁気共鳴	AP-100016	核磁気共鳴装置(NMR)(固体試料専用)	日本電子	ECX-400	32,000	2,800	3,000	35,200	7,900	10,200	触
電磁気分析装置/核磁気共鳴	AP-100017	核磁気共鳴装置(NMR)(液体試料専用)	日本電子	ECX-400	32,000	2,600	2,700	35,200	7,200	9,400	触
電磁気分析装置/核磁気共鳴	AP-100089	500MHz NMR測定装置(cancer)(液体試料専用)	アジレント・テクノロジー	Unity INOVA 500	24,000	3,100	3,300	26,400	3,900	5,000	先
電磁気分析装置/核磁気共鳴	AP-100121	超伝導フーリエ変換核磁気共鳴装置(液体試料専用)	ブルカー・バイオスピン	AVANCE III HD	48,000	1,600	1,700	52,800	22,600	29,300	理
電磁気分析装置/核磁気共鳴	AP-100134	600MHz 固体高分解能核磁気共鳴装置(固体試料専用)	ジオル・レゾナンス	ECA600 II	80,000	4,200	4,400	88,000	19,400	25,200	先
電磁気分析装置/核磁気共鳴	AP-100143	電子スピン共鳴装置	ブルカー・バイオスピン	EMX plus	8,000	200	200	8,800	2,600	3,400	情
電磁気分析装置/核磁気共鳴	AP-100183	600MHz NMR測定装置(pegasus)(液体試料専用)	ブルカー・バイオスピン ほか	AVANCE 600 ほか	24,000	4,300	4,400	26,400	20,700	26,900	先
電磁気分析装置/核磁気共鳴	AP-100186	多重極限下NMR分光測定装置	アポロ	HF-1	16,000	400	500	17,600	800	1,100	理
電磁気分析装置/核磁気共鳴	AP-100189	核磁気共鳴装置(NMR)(液体試料専用)	ジオル・レゾナンス	ECX-400P	8,000	1,300	1,400	8,800	5,200	6,800	薬
電磁気分析装置/核磁気共鳴	AP-100190	核磁気共鳴装置(NMR)(液体試料専用)	ジオル・レゾナンス	ECS-400	8,000	1,200	1,300	8,800	5,700	7,300	薬
電磁気分析装置/核磁気共鳴	AP-100191	核磁気共鳴装置(NMR)(液体試料専用)	ジオル・レゾナンス	ECZ-500R	8,000	1,900	2,000	8,800	7,600	9,800	薬
電磁気分析装置/核磁気共鳴	AP-100222	600MHz NMR測定装置(libra)(液体試料専用)	アジレント・テクノロジー	Unity INOVA 600AA	24,000	3,100	3,200	26,400	18,800	24,400	先
電磁気分析装置/核磁気共鳴	AP-100223	500MHz NMR測定装置(scorpio)(液体試料専用)	パリアン	-	24,000	2,600	2,700	26,400	7,900	10,300	先
電磁気分析装置/核磁気共鳴	AP-100263	800MHz NMR測定装置(migi)(液体試料専用)	ブルカー・ジャパン	AVANCE NEO	32,000	9,000	9,500	35,200	56,500	73,500	先
電磁気分析装置/核磁気共鳴	AP-100264	800MHz NMR測定装置(hidari)(液体試料専用)	ブルカー・ジャパン	AVANCE NEO	32,000	8,800	9,300	35,200	56,300	73,200	先
電磁気分析装置/核磁気共鳴	AP-100265	600MHz NMR測定装置(taurus)(液体試料専用)	ブルカー・バイオスピン	AVANCE III HD	24,000	3,200	3,400	26,400	20,500	26,600	先
電磁気分析装置/核磁気共鳴	AP-100282	600MHz 溶液NMR測定装置	日本電子	JNM-ECA600	48,000	2,000	2,100	52,800	8,500	11,100	先
電磁気分析装置/核磁気共鳴	AP-100283	卓上NMR測定装置	Magritek	Spinsolve 60MHz HF ULTRA	48,000	1,000	1,000	52,800	2,800	3,700	先
電磁気分析装置/核磁気共鳴	AP-100287	核磁気共鳴装置(NMR)	日本電子	ECZ400S	8,000	1,000	1,100	8,800	4,200	5,400	薬
電磁気分析装置/核磁気共鳴	AP-100308	核磁気共鳴装置(400MHz-A)	日本電子	ECS400	16,000	2,700	2,700	17,600	6,400	8,300	工
電磁気分析装置/核磁気共鳴	AP-100309	核磁気共鳴装置(400MHz-C)	日本電子	ECS400	16,000	2,700	2,700	17,600	5,400	7,000	工
電磁気分析装置/核磁気共鳴	AP-100310	核磁気共鳴装置(400MHz-S)	日本電子	ECZ400S	16,000	2,200	2,300	17,600	7,300	9,400	工
電磁気分析装置/核磁気共鳴	AP-100312	核磁気共鳴装置(400MHz NMR)	日本電子	ECZ400S	16,000	1,300	1,300	17,600	3,800	5,000	農
電磁気分析装置/核磁気共鳴	AP-100320	核磁気共鳴装置(400Hz)	日本電子	ECZ400S	8,000	2,000	2,000	8,800	5,400	7,000	水
電磁気分析装置/核磁気共鳴	AP-100350	300MHz NMR測定装置	ブルカー・バイオスピン	AVANCE III 300 Nanobay	16,000	900	900	17,600	3,700	4,800	地
電磁気分析装置/核磁気共鳴	AP-100356	核磁気共鳴装置(NMR)(液体試料専用)	日本電子	ECZ-600R	16,000	2,400	2,500	17,600	7,900	10,300	触
電磁気分析装置/核磁気共鳴	AP-100374	核磁気共鳴装置(400MHz-B)	日本電子	JNM-ECS400	16,000	2,300	2,400	17,600	5,300	6,900	工

■設備利用料金 (2025.7.1) 赤字:新規登録設備

区分	装置番号	設備	メーカー	型式	学内			学外			管理 部局
					初回講習料 (1回当たり)	利用料金(1時間当たり)		初回講習料 (1回当たり)	利用料金(1時間当たり)		
						装置管理局内	装置管理局外		公的機関	一般	
電磁気分析装置/核磁気共鳴	AP-100375	核磁気共鳴装置(600MHz-R)	日本電子	JNM-ECZ600R	24,000	2,700	2,800	26,400	13,900	18,000	工
画像分析装置	AP-100061	電界放射型走査型電子顕微鏡	日本電子	JSM-6700FT	20,000	1,600	1,700	22,000	1,900	2,400	電
画像分析装置	AP-100076	分子間力プローブ顕微鏡	アサイラム テクノロジー	MFP-3D-BIO-J	24,000	800	800	26,400	2,900	3,800	創
画像分析装置	AP-100093	小動物用X線CT装置	日立アロカメディカル	LCT-200	8,000	700	800	8,800	5,000	6,500	遺
画像分析装置	AP-100094	IVIS Spectrum Imaging System (遺制研)	キャリバーライフサイエンス	Spectrum-FL-TKHD	16,000	700	700	17,600	7,900	10,300	遺
画像分析装置	AP-100102	蛍光相関顕微鏡システム	カールツアイス	ConfoCor2	16,000	1,500	1,500	17,600	3,100	4,000	先
画像分析装置	AP-100114	多光子励起共焦点レーザー走査型多機能顕微鏡システム	オリンパス、スペクトラ・フィジクス	FV300-TP2-SK、MaiTai-HSS-E	64,000	2,000	2,100	70,400	5,000	6,500	電
画像分析装置	AP-100159	オールインワン蛍光顕微鏡	キーエンス	BZ-X700	8,000	300	300	8,800	800	1,100	創
画像分析装置	AP-100164	原子間力顕微鏡システム	JPKインスツルメンツ	NanoWizard NW3-01H	16,000	700	700	17,600	2,500	3,200	創
画像分析装置	AP-100202	バーチャルスライドシステム	浜松ホトニクス	Nano Zoomer 2.0-RS	16,000	600	600	17,600	4,500	5,800	獣
画像分析装置	AP-100221	走査型プローブ顕微鏡	島津製作所	SPM-9600	8,000	100	100	8,800	800	1,000	地
画像分析装置	AP-100230	蛍光スキャナー	GEヘルスケア	Typhoon FLA9500BGR	-	100	100	-	1,300	1,700	獣
画像分析装置	AP-100231	オールインワン蛍光顕微鏡	キーエンス	BIOREVO BZ-9000	-	100	100	-	1,100	1,500	獣
画像分析装置	AP-100237	オージェ電子分光装置	日本電子	JAMP-9500F	32,000	2,000	2,100	35,200	11,200	14,600	工
画像分析装置	AP-100239	走査型電子顕微鏡	日本電子	JSM-6510LA	16,000	700	800	17,600	2,100	2,800	工
画像分析装置	AP-100250	透過型電子顕微鏡	日本電子	JEM-1400plus	8,000	1,300	1,400	8,800	3,600	4,600	獣
画像分析装置	AP-100251	走査型電子顕微鏡	日立ハイテクノロジーズ	SU8010	8,000	800	900	8,800	3,200	4,200	獣
画像分析装置	AP-100253	超高分解能走査型電子顕微鏡	日立ハイテクノロジーズ	SU8230	24,000	2,700	2,800	26,400	6,700	8,700	電
画像分析装置	AP-100273	破壊型トモグラフィー装置	(自作)	-	-	-	-	-	-	-	理
画像分析装置	AP-100280	オールインワン蛍光顕微鏡	キーエンス	BZ-X800	8,000	100	300	8,800	1,400	1,900	水
画像分析装置	AP-100292	オールインワン蛍光顕微鏡	キーエンス	BZ-X710	8,000	200	200	8,800	800	1,000	医
画像分析装置	AP-100311	A画像解析システム AIVIA	DRVision Technologies	AIVIA 3D解析パッケージ	8,000	400	400	8,800	600	800	電
画像分析装置	AP-100340	A画像解析装置 Avivia	DRVision Technologies	Aivia 9.0 CF Go	8,000	500	500	8,800	1,100	1,400	理
画像分析装置	AP-100344	走査透過型分析電子顕微鏡	日本電子	JEM-2100	16,000	1,900	2,000	17,600	3,300	4,200	工
画像取得装置	AP-100148	収差補正走査型透過電子顕微鏡	日本電子	JEM-ARM200F	40,000	5,100	5,200	44,000	23,500	30,500	電
画像取得装置	AP-100333	量子・電子制御ナノマテリアル顕微物性測定装置	日本電子	JEM-ARM200F NEOARM	32,000	4,700	4,800	35,200	16,700	21,700	工
成膜・加工装置	AP-100042	集束イオンビーム加工観察装置	日立	FB-2100	20,000	2,800	2,800	22,000	6,900	9,000	電
成膜・加工装置	AP-100095	イオンビームスパッタ装置	アルバック	IBS-6000S	12,000	2,000	2,000	13,200	3,000	3,900	電
成膜・加工装置	AP-100096	イオンミリング装置	アルバック	IBE-6000S	12,000	1,600	1,600	13,200	2,400	3,000	電
成膜・加工装置	AP-100177	ロータリーマイクローム	サーモフィッシャーサイエンティフィック	HM325	8,000	300	300	8,800	500	600	創
成膜・加工装置	AP-100209	集束イオンビーム加工観察装置	日本電子	JEM-9320FIB	-	2,200	2,300	-	7,000	9,000	工
成膜・加工装置	AP-100270	クロスセクションポリリッシャ(CP)	日本電子	SM-09010	32,000	600	600	35,200	1,500	2,000	工
成膜・加工装置	AP-100271	イオンスライサー(薄膜試料作製装置)	日本電子	EM-09100IS	32,000	600	600	35,200	700	900	工
成膜・加工装置	AP-100295	ジェントルミル(低エネルギーイオンミリング装置)	TECHNOORG LINDA	IV-8	32,000	2,500	2,500	35,200	2,700	3,500	工
成膜・加工装置	AP-100327	精密イオンミリングシステム	Gatan	PIPS II model 695	32,000	1,500	1,500	35,200	1,800	2,300	電
成膜・加工装置	AP-100330	ガラスインプリント装置	芝浦機械	GMP-415V	32,000	2,300	2,300	35,200	6,800	8,800	電
成膜・加工装置	AP-100345	Arイオン研磨装置	Gatan	PIPS model 691	16,000	500	500	17,600	1,200	1,600	工
表面分析・形態観測用装置	AP-100001	環境制御型走査型原子間力顕微鏡(AFM)	日本ビーコ	Nanoscope IIIa	24,000	900	1,000	26,400	3,600	4,700	創
表面分析・形態観測用装置	AP-100002	共焦点レーザー走査型顕微鏡	オリンパス	FLUOVIEW FV300	16,000	800	800	17,600	1,900	2,400	創
表面分析・形態観測用装置	AP-100018	高分解能電界放射型走査型電子顕微鏡	日本電子	JSM-7400F	32,000	2,100	2,100	35,200	6,900	8,900	触
表面分析・形態観測用装置	AP-100019	低真空走査型電子顕微鏡	日本電子	JSM-6360LA	32,000	1,300	1,400	35,200	1,700	2,200	触
表面分析・形態観測用装置	AP-100047	分子間力プローブ顕微鏡	Asylum Research	Molecular Force Probe 3D	128,000	600	600	140,800	1,700	2,200	電
表面分析・形態観測用装置	AP-100071	カラー3Dレーザー顕微鏡	キーエンス	VK-9700	8,000	100	100	8,800	1,300	1,700	創
表面分析・形態観測用装置	AP-100078	電界放射型透過型電子顕微鏡	日本電子	JEM-2100F	32,000	3,600	3,700	35,200	7,900	10,200	触

■設備利用料金 (2025.7.1) 赤字:新規登録設備

区分	装置番号	設備	メーカー	型式	学内			学外		管理 部局	
					初回講習料 (1回当たり)	利用料金(1時間当たり)		初回講習料 (1回当たり)	利用料金(1時間当たり)		
						装置管理部局内	装置管理部局外		公的機関		一般
表面分析・形態観測用装置	AP-100130	形状測定レーザー顕微鏡システム	キーエンス	VK-X200	8,000	600	600	8,800	2,200	2,800	創
表面分析・形態観測用装置	AP-100243	ショットキー電界放出形走査電子顕微鏡(FE-SEM)	日本電子	JSM-6500F	32,000	2,800	2,800	35,200	6,500	8,400	工
表面分析・形態観測用装置	AP-100244	透過電子顕微鏡(TEM)	日本電子	JEM-2010	32,000	2,700	2,700	35,200	6,600	8,600	工
表面分析・形態観測用装置	AP-100245	フィールドエミッション電子プローブマイクロアナライザ(FE-EPMA)	日本電子	JXA-8530F	32,000	3,900	3,900	35,200	12,300	16,000	工
表面分析・形態観測用装置	AP-100246	複合ビーム加工観察装置(FIB-SEM)	日本電子	JIB-4601F	32,000	4,200	4,200	35,200	8,200	10,700	工
表面分析・形態観測用装置	AP-100247	複合ビーム加工観察装置(FIB-SEM)EDS・EBSDオプション	日本電子	JED-2300(EDS)、IB-Z10053T3DEBS(EBSD)	-	400	400	-	1,200	1,500	工
表面分析・形態観測用装置	AP-100268	透過電子顕微鏡(TEM)	日本電子	JEM-2010	32,000	1,900	1,900	35,200	3,200	4,100	工
表面分析・形態観測用装置	AP-100294	ショットキー電界放出形走査電子顕微鏡(FE-SEM)	日本電子	JSM-7200F	8,000	3,200	3,200	8,800	6,100	7,900	工
表面分析・形態観測用装置	AP-100313	原子間力顕微鏡(AFM)	日立ハイテック	SPA-400	8,000	300	300	8,800	1,300	1,600	工
表面分析・形態観測用装置	AP-100314	共焦点レーザー走査型顕微鏡(LSCM)	レーザーテック	1LM21D	8,000	200	200	8,800	1,100	1,400	工
表面分析・形態観測用装置	AP-100315	クロスセクションポリリッシャ(GP)	日本電子	SM-09010	16,000	500	500	17,600	1,300	1,700	工
表面分析・形態観測用装置	AP-100316	クライオクロスセクションポリリッシャ(CCP)	日本電子	IB-19520CCP	16,000	700	700	17,600	2,500	3,300	工
表面分析・形態観測用装置	AP-100335	顕微鏡用撮影装置 i-NTER LENS	マイクロネット	MR-6i-P7	8,000	100	100	-	-	-	理
表面分析・形態観測用装置	AP-100348	ワンショット3D形状測定機	キーエンス	VR-6000/6200	8,000	100	100	8,800	700	800	電
バイオ関連分析装置	AP-100004	フローサイトメーター	ベクトン・ディッキンソン	FACSCanto	24,000	1,200	1,200	26,400	3,200	4,200	創
バイオ関連分析装置	AP-100007	超遠心分離機	ベックマン・コールター	L-80XP	8,000	500	500	8,800	1,600	2,000	創
バイオ関連分析装置	AP-100064	リアルタイム定量PCRシステム	アジレント・テクノロジー	Mx3005P-S	20,000	100	100	22,000	500	700	創
バイオ関連分析装置	AP-100073	桌上セルソーターシステム	ベイバイオサイエンス	JSAN	24,000	1,300	1,300	26,400	5,900	7,700	創
バイオ関連分析装置	AP-100092	3130ジェネティックアナライザ 1号機 (遺制研)	ライフテクノロジーズ	ABI PRISM 3100 Avant	16,000	1,100	1,200	17,600	3,200	4,200	遺
バイオ関連分析装置	AP-100099	モレキュラーイメージャー(化学発光検出)	バイオ・ラッド ラボラトリーズ	ChemiDoc MP	8,000	100	100	8,800	600	800	創
バイオ関連分析装置	AP-100104	高速レーザー共焦点顕微鏡	ニコン	A1	24,000	1,500	1,500	26,400	3,100	4,100	電
バイオ関連分析装置	AP-100105	全反射蛍光顕微鏡・リアルタイム共焦点顕微鏡	ニコン	Ti-E、EM-CCD	24,000	800	800	26,400	1,100	1,400	電
バイオ関連分析装置	AP-100106	多色蛍光タイムラプス顕微鏡	ニコン	Ti-E	24,000	400	500	26,400	700	900	電
バイオ関連分析装置	AP-100123	フローサイトメーター(遺制研)	ベクトン・ディッキンソン	FACSAria II	24,000	1,800	1,800	26,400	10,400	13,500	遺
バイオ関連分析装置	AP-100125	高圧凍結装置	ライカマイクロシステムズ	EM HPM100	16,000	600	600	17,600	3,100	4,000	創
バイオ関連分析装置	AP-100126	凍結置換装置	ライカマイクロシステムズ	EM AFS2	8,000	400	400	8,800	1,000	1,300	創
バイオ関連分析装置	AP-100127	ウルトラマイクローム	ライカマイクロシステムズ	EM UC7i	16,000	400	400	17,600	1,300	1,700	創
バイオ関連分析装置	AP-100138	全反射倒立顕微鏡	ニコン、アンドール ほか	TE2000-E特型、Zyla 5.5 sCMOS ほか	16,000	400	400	17,600	1,200	1,600	先
バイオ関連分析装置	AP-100155	微量高速冷却遠心機	トミー精工	MX-307	8,000	300	300	8,800	500	600	創
バイオ関連分析装置	AP-100156	ダイレクトヒート型CO2インキュベーター	アステック	SCA-165DRS	8,000	400	400	8,800	500	700	創
バイオ関連分析装置	AP-100160	超高速レーザー共焦点顕微鏡	ニコン	A1Rsi	24,000	1,900	1,900	26,400	5,400	7,000	電
バイオ関連分析装置	AP-100161	桌上セルソーターシステム	ベイバイオサイエンス	JSANデスクトップ DCS-380	16,000	2,200	2,200	17,600	7,200	9,300	創
バイオ関連分析装置	AP-100162	凍結切片作製装置	サーモフィッシャーサイエンティフィック	クリオスター NX-50 H	8,000	400	400	8,800	900	1,200	創
バイオ関連分析装置	AP-100165	超純水・純水製造装置	メルク	Mili-Q Integral MT3	8,000	700	700	8,800	1,100	1,400	創
バイオ関連分析装置	AP-100166	サーマルサイクラー	バイオ・ラッド ラボラトリーズ	T100	8,000	300	300	8,800	400	500	創
バイオ関連分析装置	AP-100167	サーマルサイクラー	バイオ・ラッド ラボラトリーズ	T100	8,000	300	300	8,800	400	500	創
バイオ関連分析装置	AP-100168	タッチパネル式高性能ゲル撮影装置	アトー	WSE-5200A-CP	8,000	300	300	8,800	400	500	創
バイオ関連分析装置	AP-100169	リアルタイムPCR解析システム	バイオ・ラッド ラボラトリーズ	CFX96	8,000	300	300	8,800	800	1,000	創
バイオ関連分析装置	AP-100170	全自動ハイスルーブット電気泳動システム	アジレント・テクノロジー	テーブステーション4200	8,000	300	300	8,800	800	1,100	創
バイオ関連分析装置	AP-100175	バイオクリーンベンチ	パナソニックヘルスケア	MCV-B131F-PJ	8,000	300	300	8,800	500	700	創
バイオ関連分析装置	AP-100192	高速液体クロマトグラフィー	GEヘルスケア	ÅKTA explorer 100	24,000	300	300	26,400	1,500	1,900	先
バイオ関連分析装置	AP-100197	フローサイトメーター	ベクトン・ディッキンソン	FACS Verse 2レーザー6カラー	16,000	800	800	17,600	2,100	2,700	獣
バイオ関連分析装置	AP-100198	フローサイトメーター(オートローダー付)	ベクトン・ディッキンソン	FACS Verse 2レーザー6カラー	16,000	800	800	17,600	2,400	3,100	獣
バイオ関連分析装置	AP-100211	薬物動態・薬効評価装置	ウオーターズ	ACQUITY UPLC、Xevo TQ-S	16,000	900	900	17,600	6,800	8,800	薬

■設備利用料金 (2025.7.1) 赤字:新規登録設備

区分	装置番号	設備	メーカー	型式	学内			学外			管理 部局
					初回講習料 (1回当たり)	利用料金(1時間当たり)		初回講習料 (1回当たり)	利用料金(1時間当たり)		
						装置管理部局内	装置管理部局外		公的機関	一般	
バイオ関連分析装置	AP-100212	フローサイトメーター	ベックマン・コールター	6 COLORS/2 LASER	8,000	400	500	8,800	1,800	2,300	薬
バイオ関連分析装置	AP-100213	セルソーター	ソニー	SH-800	16,000	500	500	17,600	3,300	4,200	薬
バイオ関連分析装置	AP-100214	表面プラズモン共鳴解析装置	GEヘルスケア	Biacore T200	16,000	1,100	1,200	17,600	5,400	7,000	薬
バイオ関連分析装置	AP-100216	等温滴定型熱量計	マルバーン	Microcal Auto-iTC200	8,000	700	700	8,800	4,600	5,900	薬
バイオ関連分析装置	AP-100217	示差走査型熱量計	マルバーン	MicroCal VP-Capillary DSC	8,000	200	300	8,800	3,100	4,100	薬
バイオ関連分析装置	AP-100218	創薬支援自動化スクリーニング装置	和光	HORNET-HTS(R)	16,000	4,600	4,700	17,600	11,100	14,500	薬
バイオ関連分析装置	AP-100220	マルチプレートリーダー	パーキンエルマー	EnSpire	8,000	200	300	8,800	900	1,100	薬
バイオ関連分析装置	AP-100224	リアルタイムPCR解析システム	バイオ・ラッド	CFX96 Touch	4,000	100	100	4,400	700	800	薬
バイオ関連分析装置	AP-100225	リアルタイムPCR解析システム	バイオ・ラッド	CFX384 Touch	4,000	100	100	4,400	700	900	薬
バイオ関連分析装置	AP-100226	液体クロマトグラフィー	バイオ・ラッド	NGCquest	8,000	400	400	8,800	800	1,100	薬
バイオ関連分析装置	AP-100228	次世代シーケンサー	ライフテクノロジーズ	Ion Proton	128,000	200	200	140,800	3,300	4,300	獣
バイオ関連分析装置	AP-100229	表面プラズモン共鳴測定装置	GEヘルスケア	Biacore X100	128,000	200	200	140,800	1,600	2,100	獣
バイオ関連分析装置	AP-100248	組織切片作成システム	大和光機工業	CR-502	-	100	100	-	400	500	獣
バイオ関連分析装置	AP-100252	マルチプレックスアッセイ装置	ルミネックス	Luminex200	16,000	200	200	17,600	1,200	1,500	獣
バイオ関連分析装置	AP-100258	超解像顕微鏡	ニコン	N-SIM	24,000	3,000	3,000	26,400	4,100	5,300	電
バイオ関連分析装置	AP-100284	共焦点レーザー顕微鏡	カールツァイス	LSM980	24,000	2,000	2,000	26,400	4,100	5,300	理
バイオ関連分析装置	AP-100293	高速多光子共焦点レーザー顕微鏡	ニコン	A1 R MP	24,000	3,100	3,200	26,400	8,600	11,200	電
バイオ関連分析装置	AP-100297	光学顕微鏡カメラシステム	カールツァイス	Axiophot, Axiocam 705 color	8,000	100	100	8,800	1,300	1,600	農
バイオ関連分析装置	AP-100305	クライオ透過型電子顕微鏡(Glacios クライオTEM)	サーモフィッシャーサイエンティフィック	Glacios	64,000	2,600	2,600	70,400	14,300	18,600	薬
バイオ関連分析装置	AP-100306	クライオ透過型電子顕微鏡(Krios G4 クライオTEM)	サーモフィッシャーサイエンティフィック	Krios G4	64,000	3,400	3,400	70,400	18,500	24,100	薬
バイオ関連分析装置	AP-100307	試料急速凍結装置(Vitrobotシステム)	サーモフィッシャーサイエンティフィック	Vitrobot Mark IV	24,000	500	500	26,400	2,300	2,900	薬
バイオ関連分析装置	AP-100317	マルチモードプレートリーダー	モレキュラーデバイス	SpectraMax iD3	8,000	100	100	8,800	500	700	水
バイオ関連分析装置	AP-100318	DNAシーケンサー	サーモフィッシャーサイエンティフィック	SeqStudio 8 Flex	24,000	900	900	26,400	3,600	4,700	水
バイオ関連分析装置	AP-100319	スライドスキャナー装置	オリンパス	VS200, スライドローダー	8,000	100	100	8,800	1,800	2,400	医
バイオ関連分析装置	AP-100322	化学発光・蛍光・可視光イメージング装置	アトー	WSE-6270LuminoGraph II EM	2,000	100	100	2,200	600	700	水
バイオ関連分析装置	AP-100336	超音波高性能DNA断片化装置	Covaris	M220	8,000	100	100	8,800	700	900	理
バイオ関連分析装置	AP-100337	全自動電気泳動システム TapeStation	アジレント・テクノロジー	4150	8,000	200	200	8,800	500	600	理
バイオ関連分析装置	AP-100338	多光子励起レーザー走査型顕微鏡(正立)	オリンパス	FV1000MPE	16,000	2,300	2,400	17,600	7,000	9,100	理
バイオ関連分析装置	AP-100339	倒立型リアルタイム顕微鏡/IR-LEGOシステム	ニコン、ピンポイントフォトニクス	ECLIPSE Ti2-E, Pixel illuminator-C	8,000	1,200	1,300	8,800	2,600	3,300	理
バイオ関連分析装置	AP-100346	セルソーター	ソニー	SH800S	24,000	300	300	26,400	3,400	4,400	水
バイオ関連分析装置	AP-100367	倒立型顕微鏡システム	ニコン	Eclipse Ti2-E	8,000	100	100	8,800	600	700	先
バイオ関連分析装置	AP-100368	DNA自動分離装置	クラボウ	PI-480	8,000	1,300	1,500	8,800	2,300	2,900	先
バイオ関連分析装置	AP-100369	セルソーター	ソニー	SH800S	8,000	1,600	1,900	8,800	4,500	5,900	先
バイオ関連分析装置	AP-100377	DNAシーケンサー	サーモフィッシャーサイエンティフィック	SeqStudio	16,000	600	600	17,600	1,900	2,500	農
バイオ関連分析装置	AP-100379	小動物用体組成分析装置・EchoMR4-in-1	Echo Medical Systems	EMS-4-in-1	8,000	200	200	8,800	3,200	4,100	低
バイオ関連分析装置	AP-100383	超遠心分離機	ベックマン・コールター	Optima XPN-90	8,000	400	400	8,800	2,600	3,400	創
バイオ関連分析装置	AP-100390	超解像イメージング共焦点顕微鏡	カールツァイス	LSM 900 with Airyscan 2 ほか	16,000	100	100	17,600	6,000	7,800	先
バイオ関連分析装置	AP-100393	フローサイトメーター	ベックマン・コールター	CytoFLEX S	24,000	1,100	1,200	26,400	3,500	4,600	創
バイオ関連分析装置	AP-100398	示差走査型熱量計	マルバーン・バナリティカル	MicroCal PEAQ-DSC Automated	8,000	600	600	8,800	3,300	4,300	農
バイオ関連分析装置	AP-100399	等温滴定型熱量計	マルバーン・バナリティカル	MicroCal PEAQ-ITC Automated	8,000	900	900	8,800	5,100	6,600	農
バイオ関連分析装置	AP-100402	長鎖DNAシーケンサー	Oxford Nanopore	GridION Mk1	16,000	1,000	1,000	17,600	2,500	3,200	農
バイオ関連分析装置	AP-100403	DNA断片ゲル抽出装置	Sage Science	BluePippin	16,000	100	100	17,600	600	700	農
バイオ関連分析装置	AP-100405	光合成総合解析システム	メイワフォーシス	LI-6800	48,000	1,000	1,000	52,800	4,900	6,400	農
バイオ関連分析装置	AP-100406	非破壊型光合成電子伝達解析装置	Walz	DUAL-KLAS-NIR	48,000	1,000	1,000	52,800	3,200	4,100	農

■設備利用料金 (2025.7.1) 赤字:新規登録設備

区分	装置番号	設備	メーカー	型式	学内			学外			管理 部局
					初回講習料 (1回当たり)	利用料金(1時間当たり)		初回講習料 (1回当たり)	利用料金(1時間当たり)		
						装置管理部局内	装置管理部局外		公的機関	一般	
バイオ関連分析装置・画像分析装置	AP-100219	ハイコンテンツイメージングシステム	パーキンエルマー	Operetta	24,000	800	900	26,400	3,700	4,800	薬
専用測定装置	AP-100021	吸着測定装置	ユアサイオニクス	Autosorb 6AG	32,000	1,000	1,100	35,200	3,400	4,400	触
専用測定装置	AP-100053	ファイバー光学動的光散乱光度計	大塚電子	FDLS-3000	24,000	1,400	1,500	26,400	3,100	4,000	創
専用測定装置	AP-100055	同位体顕微鏡システム	(自作)	-	192,000	10,300	10,300	211,200	50,100	65,100	創
電磁気分析装置/伝導率測定	AP-100081	磁気特性測定装置 MPMS-XL	カンタム・デザイン	MPMS-XL50JS	16,000	700	800	17,600	2,500	3,200	理
電磁気分析装置/伝導率測定	AP-100082	物理特性測定装置(PPMS)	カンタム・デザイン	PPMS-9LIS	32,000	3,600	3,600	35,200	9,500	12,300	理
専用測定装置	AP-100087	ソーラシミュレータ	ワコム電創	WXS-156S-L2、AM1.5GMM	24,000	1,400	1,400	26,400	4,800	6,200	電
専用測定装置	AP-100124	次世代同位体顕微鏡システム	カメカ	IMS-1280-HR	192,000	9,400	9,800	211,200	49,500	64,400	創
専用測定装置	AP-100133	多重極限高磁場(19/17T)測定装置	クライオジェニックリミテッド	19T-52-H3	8,000	900	1,000	8,800	2,400	3,100	理
専用測定装置	AP-100179	複合量子ビーム超高圧電子顕微鏡	日本電子	JEM-ARM1300	28,000	4,700	4,800	30,800	7,600	9,900	工
専用測定装置	AP-100181	糖鎖自動前処理装置	システム・インストルメンツ	SweetBlot 4号機	40,000	900	900	44,000	4,000	5,200	先
専用測定装置	AP-100182	糖鎖自動前処理装置	システム・インストルメンツ	SweetBlot 7号機	32,000	900	900	35,200	3,300	4,300	先
専用測定装置	AP-100193	湿度制御機能付き熱重量分析装置	リガク	Thermo plus EVO II TG8120 HUM-1F	32,000	200	200	35,200	1,100	1,400	先
専用測定装置	AP-100195	粘弾性測定システム	ディー・エイ・インストルメント	ARES-G2 ほか	16,000	800	800	17,600	2,700	3,400	先
専用測定装置	AP-100196	接触角計	協和界面科学	DropMaster300	8,000	100	100	8,800	300	400	先
専用測定装置	AP-100203	磁気特性測定装置(MPMS3)	カンタム・デザイン	MPMS3	8,000	500	700	8,800	2,300	2,900	理
専用測定装置	AP-100205	物性特性測定装置(PPMS-14T)	カンタム・デザイン	PPMS-14T	8,000	800	1,100	8,800	5,700	7,400	理
専用測定装置	AP-100206	光交流法比熱測定装置	アドバンス理工	ACC-VL1M	8,000	400	500	8,800	1,500	2,000	理
専用測定装置	AP-100208	セルソーター	ベクトン・ディッキンソン	FACSAria II	16,000	2,200	2,300	17,600	5,500	7,200	獣
専用測定装置	AP-100242	ガスクロマトグラフ同位体比質量分析計(アミノ酸の安定窒素同位体比測定用)	(自作)	-	128,000	4,900	5,000	140,800	9,300	12,000	低
専用測定装置	AP-100249	ゲルマニウムγスペクトロメーター	セイコー・イーザー&ジー	SEG-EMS	8,000	100	100	8,800	1,600	2,100	獣
専用測定装置	AP-100267	粒子径分布測定装置	マイクロラック・ベル	MT3300EX II	32,000	800	800	35,200	1,700	2,100	工
専用測定装置	AP-100285	高精度比表面積・細孔分布測定装置BERSORP-max	マイクロラック・ベル	BERSORP-max	16,000	300	300	17,600	1,400	1,800	地
専用測定装置	AP-100286	高精度比表面積・細孔分布測定装置BERSORP-mini	マイクロラック・ベル	BERSORP-mini	16,000	200	200	17,600	700	800	地
専用測定装置	AP-100296	精密万能試験機(材料力学試験機)	島津製作所	AGX-V	24,000	700	700	26,400	1,700	2,100	先
専用測定装置	AP-100298	電気的特性評価装置	ズースマイクロテック、アジレント	PM5、4156C	4,000	100	100	4,400	1,300	1,700	量
専用測定装置	AP-100323	高精度圧力制御システム	理研精機 ほか	高流量吐出型ポンプユニットGMP-07-300-S10 ほか	16,000	100	200	17,600	900	1,200	理
専用測定装置	AP-100324	輸送現象測定システム	(自作)	-	16,000	100	300	17,600	1,000	1,200	理
専用測定装置	AP-100349	液体試料用振動式密度計	アントンパール	DMA5001	24,000	200	200	26,400	800	1,000	先
専用測定装置	AP-100353	マイクロプレートウォッシャー(96/384ウェルプレート用)	テカン	HydroSpeed	8,000	100	100	8,800	300	400	創
専用測定装置	AP-100354	走査型トンネル顕微鏡(インサート型極低温STM)	ユニソク	USS-7920LTU	48,000	5,100	5,300	52,800	6,600	8,600	理
専用測定装置	AP-100363	触針式プロファイラー(段差計)	KLA-Tencor	Alpha-Step D-500	24,000	200	400	26,400	1,000	1,300	情
専用測定装置	AP-100364	旋光計	日本分光	P-2200	8,000	100	100	8,800	200	200	地
専用測定装置	AP-100365	静的/動的光散乱測定装置(SLS/DLS)	(自作)	-	8,000	2,900	3,000	8,800	3,800	4,900	先
専用測定装置	AP-100371	ウルトラマイクロ天秤	メトラ・トレド	XP2U	4,000	300	400	4,400	600	700	創
専用測定装置	AP-100389	等温滴定型熱量計 & 示差走査型熱量計	ディー・エイ・インストルメント ジャパン	Nano ITC & Nano DSC	64,000	1,900	1,900	70,400	5,100	6,600	先
専用測定装置	AP-100396	元素分析装置	エレメンター	UNICUBE	40,000	500	600	44,000	2,100	2,700	農
専用測定装置	AP-100401	土壌フラックス測定システム	メイワフォーシス	LI-8250	16,000	100	100	17,600	6,600	8,600	農
環境試験装置	AP-100118	環境試験装置	Thermotron	S-8-8200	8,000	400	400	8,800	1,000	1,300	工
環境試験装置	AP-100278	スペースチャンバー(熱真空試験装置)	管製作所	AV240-000J	16,000	400	500	17,600	3,000	3,900	工
分離分析装置	AP-100235	ガスクロマトグラフィーエレクトンキャプチャ検出器	島津製作所	GC-2014	16,000	400	400	17,600	700	900	獣
分離分析装置	AP-100236	加熱気化水銀測定装置	日本インストルメンツ	MA-3000	16,000	600	700	17,600	1,200	1,500	獣
分離分析装置	AP-100288	Smart Flash MSシステム	山善	EPCLC-Wprep2XY、MSD-120	16,000	1,000	1,100	17,600	2,700	3,400	薬
分離分析装置	AP-100334	ガスクロマトグラフィーエレクトンキャプチャ検出器(GC/ECD)	島津製作所	GC-8A/ECD	24,000	200	200	26,400	300	400	工

■設備利用料金 (2025.7.1) 赤字:新規登録設備

区分	装置番号	設備	メーカー	型式	学内			学外			管理 部局
					初回講習料 (1回当たり)	利用料金(1時間当たり)		初回講習料 (1回当たり)	利用料金(1時間当たり)		
						装置管理部局内	装置管理部局外		公的機関	一般	
分解・蒸留・分離・濃縮・抽出装置	AP-100361	マイクロ波酸分解システム(個別高速分解用)	CEM	BLADE	24,000	2,200	2,200	26,400	3,600	4,700	創
分解・蒸留・分離・濃縮・抽出装置	AP-100362	マイクロ波酸分解システム(多検体同時分解用)	CEM	MARS6	32,000	800	800	35,200	1,300	1,600	創
分解・蒸留・分離・濃縮・抽出装置	AP-100372	無機分析前処理システム	ジーエルサイエンス、オトラートレド ほか	DigiPREP Jr.、XP205 ほか	8,000	500	800	8,800	1,600	2,100	創
X線照射装置	AP-100116	X線照射装置	日立パワーソリューションズ	MBR-1520R-4	2,000	1,000	1,100	2,200	2,800	3,600	遺
X線照射装置	AP-100259	放射線治療装置リニアック	バリアン	CLINAC600C	8,000	5,100	5,100	8,800	12,400	16,200	ア
X線照射装置	AP-100388	X線回折装置(試料吹付低温装置付)	リガク	MicroMax007,R-AXIS-IV++	64,000	800	900	70,400	22,300	29,000	先
X線照射装置	AP-100391	マルチフォーカスX線透視装置	コメットテクノロジーズ	Cheetah EVO	16,000	900	900	17,600	4,500	5,800	水
理学研究院附属天文台設置装置/天体望遠鏡	AP-100136	口径1.6m光学望遠鏡	西村製作所	NAZ-RC1600	8,000	800	800	8,800	31,100	40,400	理
理学研究院附属天文台設置装置/画像分析装置	AP-100137	口径1.6m光学望遠鏡(マルチスペクトル撮像観測装置使用時)	(自作)	-	24,000	800	800	26,400	33,200	43,100	理
ソフトウェア	AP-100385	電子線/レーザー描画露光現像シミュレータ(ソフトウェア)	GeniSys	BEAMER Pro	8,000	1,400	1,400	8,800	3,600	4,700	電

■委託分析料金 (2025.7.1)

赤字:新規登録設備

区分	装置番号	設備	メーカー	型式	学内		学外		管理 部局
					加工料等(1時間当たり)		加工料等(1時間当たり)		
					装置管理部局内	装置管理部局外	公的機関	一般	
クリーンルーム内設置装置/創成棟内	AP-100028	マスクアライナー	ミカサ	MA-20	9,700	9,700	11,700	12,600	電
クリーンルーム内設置装置/創成棟内	AP-100029	真空蒸着装置	サンバック	ED-1500R	9,900	9,900	11,800	12,700	電
クリーンルーム内設置装置/創成棟内	AP-100030	反応性イオンエッチング装置	サムコ	RIE-10NRV	11,400	11,400	15,500	17,500	電
クリーンルーム内設置装置/創成棟内	AP-100031	ICP高密度プラズマエッチング装置	サムコ	RIE-101iHS	10,700	10,800	18,100	20,900	電
クリーンルーム内設置装置/創成棟内	AP-100032	プラズマCVD装置	サムコ	PD-220ESN	11,300	11,400	17,000	19,500	電
クリーンルーム内設置装置/創成棟内	AP-100034	液体ソースプラズマCVD装置	サムコ	PD-100G1	8,900	8,900	10,000	10,300	電
クリーンルーム内設置装置/創成棟内	AP-100035	ヘリコンスパッタリング装置	アルバック	MPS-4000C1/HC1	13,000	13,100	16,400	18,700	電
クリーンルーム内設置装置/創成棟内	AP-100037	超高精度電子ビーム描画装置 125kV	エリオニクス	ELS-F125-U	14,800	15,100	39,100	48,200	電
クリーンルーム内設置装置/創成棟内	AP-100058	真空紫外光露光装置	エヌ工房	フォトリエーター PC-01-H	8,200	8,200	9,300	9,400	電
クリーンルーム内設置装置/創成棟内	AP-100077	超高精度電子ビーム描画装置 100kV	エリオニクス	ELS-7000HM	12,800	13,100	36,300	44,500	電
クリーンルーム内設置装置/創成棟内	AP-100083	ドライエッチング装置	アルバック	NLD-500	9,400	9,400	11,400	12,100	電
クリーンルーム内設置装置/創成棟内	AP-100084	反応性イオンエッチング装置	サムコ	RIE-101iPH	11,400	11,400	15,900	18,100	電
クリーンルーム内設置装置/創成棟内	AP-100085	レーザー描画装置	ネオアーク	DDB-201-200	8,700	8,700	13,000	14,300	電
クリーンルーム内設置装置/創成棟内	AP-100086	原子層堆積装置	ピコサン	SUNALE-R	11,500	11,600	16,300	18,500	電
クリーンルーム内設置装置/創成棟内	AP-100131	コンバウトスパッタ装置	アルバック	ACS-4000-C3-HS	12,500	12,500	16,700	19,000	電
クリーンルーム内設置装置/創成棟内	AP-100145	超高速スキャン高精度電子ビーム露光装置	エリオニクス	ELS-F130HM	16,500	16,600	50,700	63,200	電
クリーンルーム内設置装置/創成棟内	AP-100146	半導体薄膜堆積装置	パスカル	PAC-LMBE	10,800	10,800	17,400	20,000	電
クリーンルーム内設置装置/創成棟内	AP-100254	多元スパッタ装置	アルバック	QAM-4-ST	15,200	15,200	19,200	22,300	電
クリーンルーム内設置装置/創成棟内	AP-100255	シリコン深堀りエッチング装置	SPPテクノロジーズ	APX-ASE-Pegasus-Polestar	13,300	13,300	23,200	27,500	電
クリーンルーム内設置装置/創成棟内	AP-100256	電子ビーム蒸着装置	エイコーエンジニアリング	EB-580S	10,900	10,900	13,300	14,600	電
クリーンルーム内設置装置/創成棟内	AP-100257	レーザー顕微鏡	キーエンス	VK-9700/9710	8,800	8,800	10,800	11,300	電
クリーンルーム内設置装置/創成棟内	AP-100260	UV-オゾンクリーナー	サムコ	UV-1	8,800	8,800	9,700	9,900	電
クリーンルーム内設置装置/創成棟内	AP-100261	光学干渉式膜厚計	フィルメトリクス	F20-UV	8,800	8,800	10,000	10,400	電
クリーンルーム内設置装置/創成棟内	AP-100262	原子層堆積装置(粉末対応型)	ピコサン	R-200 advanced	13,600	13,600	20,500	24,000	電
クリーンルーム内設置装置/創成棟内	AP-100328	レーザー描画装置	ハイデルベルグ・インストルメンツ	DWL66HK	13,900	14,000	21,200	24,900	電
クリーンルーム内設置装置/創成棟内	AP-100329	プラズマ式原子層堆積装置	サムコ	AD-230LP-H	15,000	15,100	26,200	31,400	電
クリーンルーム内設置装置/創成棟内	AP-100331	卓上型ランプ加熱装置	アドバンス理工	MILA-5000-P-N	10,300	10,300	11,400	12,200	電
クリーンルーム内設置装置/創成棟内	AP-100342	微細形状測定機	小坂研究所	ET200	8,700	8,700	10,000	10,300	電
クリーンルーム内設置装置/創成棟内	AP-100343	マニュアルスパッタ	(自作)	-	8,800	8,800	10,400	10,900	電
クリーンルーム内設置装置/創成棟内	AP-100384	フッ化ケソンドライエッチング装置	サムコ	VPE-4F	10,300	10,300	12,700	13,800	電
クリーンルーム内設置装置/理学部棟内	AP-100103	超広帯域波長可変レーザー分光装置	スペクトラ・フィジックス	Tsunami3941-X1S, Opal1.3	6,800	7,100	9,300	10,100	理
クリーンルーム内設置装置/工学部棟内	AP-100299	電子ビーム描画装置	エリオニクス	ELS-3700	9,100	9,200	11,400	12,100	情
クリーンルーム内設置装置/工学部棟内	AP-100300	両面マスクアライナ	ズースマイクロテック	MA-6	8,800	8,900	13,000	14,200	情
クリーンルーム内設置装置/工学部棟内	AP-100301	EB加熱・抵抗加熱蒸着装置	アルバック	EBX-8C	11,200	11,200	12,900	14,100	情
クリーンルーム内設置装置/工学部棟内	AP-100302	スパッタ装置	菅製作所	SSP3000Plus	8,700	8,700	11,000	11,700	情
クリーンルーム内設置装置/工学部棟内	AP-100303	ダイシングソー	DISCO	DAD322	8,800	8,800	10,300	10,700	情
クリーンルーム内設置装置/工学部棟内	AP-100304	エリブソメータ	日本分光	M-500S	8,100	8,100	9,800	10,000	情
分光分析装置	AP-100079	顕微ラマンマイクロスコープシステム	レニショー	inVia Reflex	10,000	10,000	13,700	15,100	創
分光分析装置	AP-100132	振動円偏光二色性分光光度計	日本分光	JV-2001M	8,500	8,500	11,800	12,600	先

■委託分析料金 (2025.7.1)

赤字:新規登録設備

区分	装置番号	設備	メーカー	型式	学内		学外		管理 部局
					加工料等(1時間当たり)		加工料等(1時間当たり)		
					装置管理部局内	装置管理部局外	公的機関	一般	
分光分析装置	AP-100279	フーリエ変換赤外分光光度計	島津製作所	IRAffinity-1S	13,200	13,200	14,800	16,600	理
分光分析装置	AP-100341	顕微紫外可視分光装置	日本分光	MSV-5200	10,500	10,500	13,400	14,800	電
分光分析装置	AP-100355	ラマンイメージング装置	堀場製作所	HR-Evolution type pa nano	11,500	11,500	14,800	16,600	電
分光分析装置	AP-100370	時間分解分光測定装置	ユニソク	TSP-1000M-01S-H-HP-M	8,900	9,000	11,400	12,100	先
分光分析装置	AP-100381	紫外可視近赤外分光光度計(積分球付き)	島津製作所	UV-3600i Plus/MPC-603A	8,900	8,900	10,600	11,100	電
分光分析装置	AP-100382	分光蛍光光度計	日立ハイテック	F-7100	8,900	8,900	10,700	11,200	電
電磁波分析装置/X線	AP-100045	X線光電子分光装置	日本電子	JPS-9200	9,600	9,700	16,800	19,100	電
電磁波分析装置/X線	AP-100139	X線回折装置	リガク	Smart Lab	11,900	11,900	20,000	23,400	創
電磁波分析装置	AP-100269	エネルギー分散型蛍光X線分析装置(XRF)	日本電子	JSX-3100R II	9,600	9,600	11,300	12,100	工
電磁波分析装置/分光	AP-100041	超薄膜評価装置	日立	HD-2000	10,700	10,800	19,200	22,300	電
成膜・加工装置	AP-100042	集束イオンビーム加工観察装置	日立	FB-2100	10,800	10,800	15,700	17,800	電
電磁波分析装置/分光	AP-100147	時間分解光電子顕微鏡システム	エルミテック	PEEM-III	10,900	11,000	16,800	19,200	電
電磁波分析装置/分光	AP-100326	大気中光電子分光装置	理研計器	AC-3	10,500	10,500	14,800	16,500	電
電磁気分析装置/質量分析	AP-100373	マルチコレクター型質量分析装置(MC-ICP-MS)	サーモフィッシャーサイエンティフィック	NEPTUNE plus	11,500	11,500	26,000	31,100	理
電磁気分析装置/核磁気共鳴	AP-100121	超伝導フーリエ変換核磁気共鳴装置(液体試料専用)	ブルカー・バイオスピン	AVANCE III HD	9,600	9,700	31,400	38,100	理
電磁気分析装置/核磁気共鳴	AP-100134	600MHz 固体高分解能核磁気共鳴装置(固体試料専用)	ジオル・レゾナンス	ECA600 II	12,200	12,400	28,200	34,000	先
電磁気分析装置/核磁気共鳴	AP-100183	600MHz NMR測定装置(pegasus)(液体試料専用)	ブルカー・バイオスピン ほか	AVANCE 600 ほか	12,300	12,400	29,500	35,700	先
電磁気分析装置/核磁気共鳴	AP-100222	600MHz NMR測定装置(libra)(液体試料専用)	アジレント・テクノロジー	Unity INOVA 600AA	11,100	11,200	27,600	33,200	先
電磁気分析装置/核磁気共鳴	AP-100223	500MHz NMR測定装置(scorpio)(液体試料専用)	バリアン	-	10,600	10,700	16,700	19,100	先
電磁気分析装置/核磁気共鳴	AP-100263	800MHz NMR測定装置(migi)(液体試料専用)	ブルカー・ジャパン	AVANCE NEO	17,000	17,500	65,300	82,300	先
電磁気分析装置/核磁気共鳴	AP-100264	800MHz NMR測定装置(hidari)(液体試料専用)	ブルカー・ジャパン	AVANCE NEO	16,800	17,300	65,100	82,000	先
電磁気分析装置/核磁気共鳴	AP-100265	600MHz NMR測定装置(taurus)(液体試料専用)	ブルカー・バイオスピン	AVANCE III HD	11,200	11,400	29,300	35,400	先
電磁気分析装置/核磁気共鳴	AP-100282	600MHz 溶液NMR測定装置	日本電子	JNM-ECA600	10,000	10,100	17,300	19,900	先
電磁気分析装置/核磁気共鳴	AP-100283	卓上NMR測定装置	Magritek	Spinsolve 60MHz HF ULTRA	9,000	9,000	11,600	12,500	先
画像分析装置	AP-100061	電界放射型走査型電子顕微鏡	日本電子	JSM-6700FT	9,600	9,700	10,700	11,200	電
画像分析装置	AP-100076	分子間力プローブ顕微鏡	アサイラム テクノロジー	MFP-3D-BIO-J	12,400	12,400	15,700	16,600	創
画像分析装置	AP-100221	走査型プローブ顕微鏡	島津製作所	SPM-9600	10,600	10,600	12,200	12,500	地
画像分析装置	AP-100253	超高分解能走査型電子顕微鏡	日立ハイテクノロジーズ	SU8230	10,700	10,800	15,500	17,500	電
画像分析装置	AP-100273	破壊型トモグラフィ装置	(自作)	-	12,400	12,400	-	-	理
画像分析装置	AP-100311	AI画像解析システム AIVIA	DRVision Technologies	AIVIA 3D解析パッケージ	8,400	8,400	9,400	9,600	電
画像分析装置	AP-100344	走査透過型分析電子顕微鏡	日本電子	JEM-2100	9,900	10,000	12,100	13,000	工
画像取得装置	AP-100148	収差補正走査型透過電子顕微鏡	日本電子	JEM-ARM200F	13,100	13,200	32,300	39,300	電
画像取得装置	AP-100333	量子・電子制御ナノマテリアル顕微物性測定装置	日本電子	JEM-ARM200F NEOARM	12,700	12,800	25,500	30,500	工
成膜・加工装置	AP-100095	イオンビームスパッタ装置	アルバック	IBS-6000S	10,000	10,000	11,800	12,700	電
成膜・加工装置	AP-100096	イオンミリング装置	アルバック	IBE-6000S	9,600	9,600	11,200	11,800	電
成膜・加工装置	AP-100270	クロスセクションポリリッシャ(CP)	日本電子	SM-09010	8,600	8,600	10,300	10,800	工
成膜・加工装置	AP-100271	イオンスライサー(薄膜試料作製装置)	日本電子	EM-09100IS	8,600	8,600	9,500	9,700	工
成膜・加工装置	AP-100295	ジェントルミル(低エネルギーイオンミリング装置)	TECHNOORG LINDA	IV-8	10,500	10,500	11,500	12,300	工
成膜・加工装置	AP-100327	精密イオンミリングシステム	Gatan	PIPS II model 695	9,500	9,500	10,600	11,100	電

■委託分析料金 (2025.7.1)

赤字:新規登録設備

区分	装置番号	設備	メーカー	型式	学内		学外		管理 部局
					加工料等(1時間当たり)		加工料等(1時間当たり)		
					装置管理部局内	装置管理部局外	公的機関	一般	
成膜・加工装置	AP-100330	ガラスインプリント装置	芝浦機械	GMP-415V	10,300	10,300	15,600	17,600	電
成膜・加工装置	AP-100345	Arイオン研磨装置	Gatan	PIPS model 691	8,500	8,500	10,000	10,400	工
表面分析・形態観測用装置	AP-100047	分子間力プローブ顕微鏡	Asylum Research	Molecular Force Probe 3D	10,400	10,500	12,500	13,000	電
表面分析・形態観測用装置	AP-100243	ショットキー電界放出形走査電子顕微鏡(FE-SEM)	日本電子	JSM-6500F	10,800	10,800	15,300	17,200	工
表面分析・形態観測用装置	AP-100244	透過電子顕微鏡(TEM)	日本電子	JEM-2010	10,700	10,700	15,400	17,400	工
表面分析・形態観測用装置	AP-100245	フィールドエミッション電子プローブマイクロアナライザ(FE-EPMA)	日本電子	JXA-8530F	11,900	11,900	21,100	24,800	工
表面分析・形態観測用装置	AP-100246	複合ビーム加工観察装置(FIB-SEM)	日本電子	JIB-4601F	12,200	12,200	17,000	19,500	工
表面分析・形態観測用装置	AP-100268	透過電子顕微鏡(TEM)	日本電子	JEM-2010	9,900	9,900	12,000	12,900	工
表面分析・形態観測用装置	AP-100294	ショットキー電界放出形走査電子顕微鏡(FE-SEM)	日本電子	JSM-7200F	11,200	11,200	14,900	16,700	工
バイオ関連分析装置	AP-100104	高速レーザー共焦点顕微鏡	ニコン	A1	9,500	9,500	11,900	12,900	電
バイオ関連分析装置	AP-100105	全反射蛍光顕微鏡・リアルタイム共焦点顕微鏡	ニコン	Ti-E、EM-CCD	8,800	8,800	9,900	10,200	電
バイオ関連分析装置	AP-100106	多色蛍光タイムラプス顕微鏡	ニコン	Ti-E	8,400	8,500	9,500	9,700	電
バイオ関連分析装置	AP-100160	超高速レーザー共焦点顕微鏡	ニコン	A1Rsi	9,900	9,900	14,200	15,800	電
バイオ関連分析装置	AP-100161	卓上セルソーターシステム	ペイバイオサイエンス	JSANデスクトップ DCS-380	31,700	31,700	39,600	41,800	創
バイオ関連分析装置	AP-100258	超解像顕微鏡	ニコン	N-SIM	11,000	11,000	12,900	14,100	電
バイオ関連分析装置	AP-100293	高速多光子共焦点レーザー顕微鏡	ニコン	A1 R MP	11,100	11,200	17,400	20,000	電
バイオ関連分析装置	AP-100305	クライオ透過型電子顕微鏡(Glacios クライオTEM)	サーモフィッシャーサイエンティフィック	Glacios	10,600	10,600	23,100	27,400	薬
バイオ関連分析装置	AP-100306	クライオ透過型電子顕微鏡(Krios G4 クライオTEM)	サーモフィッシャーサイエンティフィック	Krios G4	11,400	11,400	27,300	32,900	薬
バイオ関連分析装置	AP-100307	試料急速凍結装置(Vitrobotシステム)	サーモフィッシャーサイエンティフィック	Vitrobot Mark IV	20,200	20,200	23,900	24,600	薬
バイオ関連分析装置	AP-100379	小動物用体組成分析装置・EchoMRI4-in-1	Echo Medical Systems	EMS-4-in-1	8,200	8,200	12,000	12,900	低
バイオ関連分析装置	AP-100405	光合成総合解析システム	メイワフォーシス	LI-6800	9,000	9,000	13,700	15,200	農
バイオ関連分析装置	AP-100406	非破壊型光合成電子伝達解析装置	Walz	DUAL-KLAS-NIR	9,000	9,000	12,000	12,900	農
専用測定装置	AP-100087	ソーラシミュレータ	ワコム電創	WXS-156S-L2、AM1.5GMM	9,400	9,400	13,600	15,000	電
専用測定装置	AP-100179	複合量子ビーム超高压電子顕微鏡	日本電子	JEM-ARM1300	12,700	12,800	16,400	18,700	工
専用測定装置	AP-100242	ガスクロマトグラフ同位体比質量分析計(アミノ酸の安定窒素同位体比測定用)	(自作)	-	15,900	16,000	21,400	24,100	低
専用測定装置	AP-100267	粒子径分布測定装置	マイクロトラック・ベル	MT3300EX II	8,800	8,800	10,500	10,900	工
専用測定装置	AP-100364	旋光計	日本分光	P-2200	8,100	8,100	9,000	9,000	地
専用測定装置	AP-100389	等温滴定型熱量計 & 示差走査型熱量計	ティー・エイ・インストルメント・ジャパン	Nano ITC & Nano DSC	9,900	9,900	13,900	15,400	先
X線照射装置	AP-100388	X線回折装置(試料吹付低温装置付)	リガク	MicroMax007,R-AXIS-IV++	8,800	8,900	31,100	37,800	先
理学研究院附属天文台設置装置/画像分析装置	AP-100137	口径1.6m光学望遠鏡(マルチスペクトル撮像観測装置使用時)	(自作)	-	8,800	8,800	42,000	51,900	理
ソフトウェア	AP-100385	電子線/レーザー描画露光現象シミュレータ(ソフトウェア)	GenSys	BEAMER Pro	9,400	9,400	12,400	13,500	電